

ABSTRACT

シートビーム式検査装置などの電子線装置は、電子線源からの一次電子線を検査対象に照射し、前記一次電子線の照射により放出された二次電子線の像を投影する電子光学系及び電子光学系により投影された二次電子線像を検出する検出器を有する。具体的には、電子線装置は、特定幅を有する電子線を照射するビーム発生手段 2004 と、該ビームを検査対象となる基板 2006 の表面に到達させる一次電子光学系 2001 と、基板 2006 から発生した二次電子を補足し画像処理系 2015 へ導く二次電子光学系 2002 と、基板 2006 を少なくとも一自由度の連続性をもって移送可能に保持するステージ 2003 と、基板 2006 の検査室と、該検査室に基板 2006 を搬入出する基板搬送機構と、基板 2006 の欠陥を検出する画像処理解析装置 2015 と、検査室の除振機構と、検査室の真空を保持する真空系と、基板 2006 の欠陥位置を表示又は記憶する制御系 2017 とを具備する。